

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成25年1月17日(2013.1.17)

【公表番号】特表2011-500319(P2011-500319A)

【公表日】平成23年1月6日(2011.1.6)

【年通号数】公開・登録公報2011-001

【出願番号】特願2010-530104(P2010-530104)

【国際特許分類】

B 08 B 3/02 (2006.01)

C 23 G 3/00 (2006.01)

【F I】

B 08 B 3/02 A

C 23 G 3/00 Z

【誤訳訂正書】

【提出日】平成24年11月19日(2012.11.19)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0011

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0011】

この方法は、下方チャンバ内のガスが洗浄液によって移動されるように、それぞれの洗浄管の出口端レベルの上方にまで下方チャンバ内に洗浄液を提供するステップを含んでいる。洗浄液はこのポイントを通過して提供され、下方チャンバ内に残ったガスが圧縮されて洗浄液が洗浄管を通って上に流れようになっている。この方法は、管内でピンを洗浄すべく、洗浄液が洗浄管を通る間に1本のデポジションピンの少なくとも一部を1本の洗浄管の出口端に配置するステップをさらに含んでいる。

【誤訳訂正2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0023

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0023】

図2は、洗浄液200が下方チャンバ105内に存在している、図1の複チャンバ型洗浄ステーション100の平面図と側断面図である。洗浄液200は、流体液面が上昇して、空気210が追い出され、管115内で押されるように洗浄液入口205を通って下方チャンバ105へと送られる。液面200は、液面に平行な基準面(例:基準面は流体の略水平レベルでよい)に対して測定される最も高い管の底開口部を覆うまで上昇する。液面200が最も高い管に到達すると、空気210はもはや上方ドレーンベースン110への通路を有さない。この状態が発生すると、上昇した液面200が下方チャンバ105の上部に閉じ込められた空気210を圧縮し、下方チャンバ105内の流体200の表面に逆圧がかけられる。流体200の表面への前記逆圧は各管115の流体を押し上げるように作用する。